



DEUTSCHES
PATENTAMT

②1 Aktenzeichen: P 34 16 864.8
②2 Anmeldetag: 8. 5. 84
④3 Offenlegungstag: 21. 11. 85

DE 34 16 864 A 1

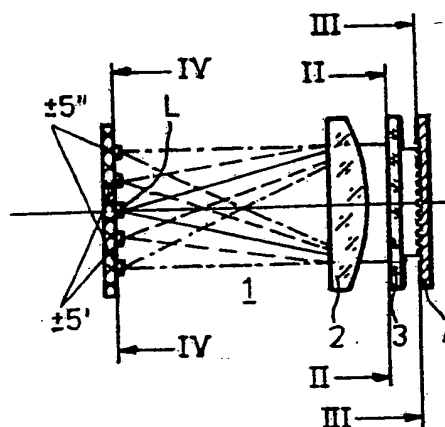
⑦1 Anmelder:
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, 8225 Traunreut, DE

⑦2 Erfinder:
Michel, Dieter, Ing.(grad.), 8220 Traunstein, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Photoelektrische Meßeinrichtung

Bei dieser photoelektrischen Meßeinrichtung ist dem Teilungsfeld (4') ein Phasengitter (4) zugeordnet. Dem Umfeld (4'') des Teilungsfeldes (4') ist ebenfalls ein Phasengitter (4) zugeordnet. Die Phasengitter (4, 4', 4'') haben eine unterschiedliche Gitterkonstante, so daß die durch sie erzeugten Beugungsbilder an verschiedenen Orten auf Photodetektoren ($\pm 5'$; $\pm 5''$) treffen, die paarweise zueinander antiparallel geschaltet sind. Daraus läßt sich ein Gegentaktsignal ableiten, das sicher ausgewertet werden kann und als Referenzsignal geeignet ist.



DE 34 16 864 A 1

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH

4. Mai 1984

Ansprüche
=====

1. Vorrichtung zur photoelektrischen Erzeugung von elektrischen Signalen bei Lagemeßeinrichtungen insbesondere von codierbaren Referenzimpulsen bei Längen- oder Winkelmeßeinrichtungen, mit
5 wenigstens einer Beleuchtungseinrichtung, Abtastplatte, wenigstens einem Längen- oder Winkelteilungsfeld auf einem Teilungsträger, wenigstens einem Photodetektor und einer Auswerteschaltung, dadurch gekennzeichnet, daß dem wenigstens einen Längen- oder Winkelteilungsfeld (4', 45' 48', 49') ein
10 Phasengitter (4, 45, 48, 49) zugeordnet ist, und daß die durch das Phasengitter (4, 45, 48, 49) erzeugten Beugungsbilder Photodetektoren (5' bis -55'') beaufschlagen, deren Lage durch die
15 Wellenlänge (λ) der verwendeten Strahlung und die Ausbildung (z.B. Gitterkonstante, Ausrichtung usw.) des Phasengitters (4, 45, 48, 49) bestimmt ist.
- 20 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der ein Längen- oder Winkelteilungsfeld als Referenzmarkenteilungsfeld ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Referenzmarkenteilungsfeld (4') als Phasengitter (4) ausgebildet ist.
- 25 3. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Referenzmarkenteilungsfeld (4') und dessen Umfeld (4'') als unterschiedliche Phasengitter ausgebildet sind.

4. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Phasengitter (4', 4'') als Rechteckprofilphasengitter mit unterschiedlicher Gitterkonstante, aber gleicher Ausrichtung ausgebildet sind.
- 5
5. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Phasengitter als Echelettephasengitter (48', 48'') mit unterschiedlicher Gitterkonstante, aber gleicher Ausrichtung ausgebildet sind.
- 10
6. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Phasengitter (49', 49'') aus Rechteckprofilphasengittern (49'') und Echelettephasengittern (49') kombiniert sind.
- 15
7. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausrichtung der Phasengitter (4, 45, 48, 49) unterschiedlich ist.
- 20
8. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Phasengitter (4, 45, 48, 49) als Auflicht- und/oder als Durchlichtgitter ausgeführt sind.
- 25
9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Lage der Photodetektoren (5' bis -55'') nach der an sich bekannten Formel $\sin \alpha = \frac{k \cdot \lambda}{d}$ und ggf. nach der Brennweite der Abbildungsoptik bestimmt.
- 30

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH

4. Mai 1984

Photoelektrische Meßeinrichtung
=====

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Derartige Vorrichtungen sind bei inkrementalen
5 Längen- oder Winkelmeßeinrichtungen üblich, damit
beispielsweise ein für die Meßeinrichtung definier-
ter Nullpunkt festgelegt und reproduziert werden
kann.

10 In der DE-OS 18 14 785 ist der Aufbau einer Referenzmarke zur Erzeugung eines Referenzimpulses beschrieben.

15 Ein genügend exakter Referenzimpuls läßt sich jedoch nur von einer derartigen Referenzmarke ableiten, wenn der Abtastabstand sehr klein ist und dementsprechend engen Toleranzen hinsichtlich der Abstandsschwankungen unterliegt.

Bei der photoelektrischen Abtastung bisher bekannter Referenzmarken erhält man Eintaktsignale. Um die zur sicheren Auswertung erforderlichen Gegen-

5 takt- bzw. Pseudogegentaktsignale zu erhalten, müssen zwei Referenzmarken bzw. eine Referenzmarke und ein Feld (z.B. Spiegel) zum Erzeugen eines Bezugssignales vorgesehen und abgetastet werden.

Durch ungleichmäßige Verschmutzung der Referenz-

10 marken und durch Abstandsänderungen beim Abtasten kann sich das erzeugte photoelektrische Signal so verändern, daß eine sichere Auswertung nicht mehr gegeben ist.

Ferner besitzen die bekannten Referenzmarken innerhalb ihres Teilungsfeldes keine Codiermöglichkeit,

15 um sie voneinander unterscheidbar zu machen.

Aus der DE-OS 23 16 248 ist ferner ein photoelektrischer Schrittgeber bekannt, der mit Phasengittern

20 arbeitet, wodurch ein größerer Abtastabstand der beiden zueinander verschiebbaren Gitter zulässig ist, und die Empfindlichkeit gegenüber Abstandsänderungen geringer wird. In dieser Druckschrift wird jedoch kein Hinweis darauf gegeben, wie beispielsweise eine Referenzmarke genügend sicher ab-

25 getastet und ausgewertet werden kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen,

30 bei der die Toleranzen der Schwankungen des Abtastabstandes vergrößert werden können, bei der ein verhältnismäßig großer Abtastabstand zulässig ist, und bei der anhand von Referenzmarken Referenzimpulse erzeugt und ggf. codiert werden können.

Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung gelöst, die die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 aufweist.

- 5 Die Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung liegen darin, daß auch bei der Abtastung von Referenzmarken ein verhältnismäßig großer Abtastabstand zulässig ist, der dementsprechend gegenüber Änderungen relativ unempfindlich ist. Ferner ist es bei dieser
10 Vorrichtung möglich, die einzelnen Referenzmarken zu codieren, so daß sie unterscheidbar und auswählbar werden.

- 15 Vorteilhafte Ausgestaltungen entnimmt man den Unteransprüchen.

- Mit Hilfe von Ausführungsbeispielen soll anhand der Zeichnungen die Erfindung noch näher erläutert werden, wobei die Darstellungen zum besseren Verständnis
20 stark vereinfacht wurden.

Es zeigen

- 25 Figur 1 eine Meßeinrichtung nach dem Auflichtverfahren arbeitend,

- Figur 2 eine Teilansicht einer Abtastplatte entlang der Linie II/II nach Figur 1,
30

- Figur 3 eine Teilansicht eines Phasengitters entlang der Linie III/III nach Figur 1.

- Figur 4 eine Ansicht auf eine Platte
mit Photodetektoren entlang der
Linie IV/IV nach Figur 1,
- 5 Figur 5 eine Meßeinrichtung nach dem
Durchlichtprinzip arbeitend,
- Figur 6 ein Schaltbild von Photodetek-
toren,
- 10 Figur 7 einen typischen Signalverlauf
eines Referenzmarken-Gegentakt-
signals,
- 15 Figur 8 Querschnitt eines Echelette-
Phasengitters mit unterschied-
licher Gitterkonstante und
- 20 Figur 9 Querschnitt einer Kombination
eines Rechteck-Phasengitters mit
einem Echelette-Phasengitter.
- In Figur 1 ist schematisch eine im Auflichtverfahren
arbeitende Meßeinrichtung 1 dargestellt. Die Strah-
25 lung einer Lichtquelle L wird durch einen Kondensor
2 auf eine Abtastplatte 3 geworfen. Wie aus Figur 2
ersichtlich ist, weist die Abtastplatte 3 ein
Teilungsfeld 3' auf, das aus einer Gruppe transpa-
renter Bereiche besteht. Das Umfeld 3'' des Teilungs-
30 felde 3' ist absorbierend. Das Teilungsfeld 3'
zeigt eine Referenzmarke, kann aber auch als perio-
dische Teilung (Inkremental-Maßstab) ausgebildet
sein. Eine derartige Ausgestaltung ist besonders
sinnvoll, wenn bei herkömmlichen (Auflicht- oder

Durchlicht-Amplitudengittern) Maßstäben die sogenannte Einfeld-Gegentaktabtastung durchgeführt werden soll, um qualitativ höherwertige Signale zu erzeugen.

5

Die durch die Abtastplatte 3 hindurchtretende Strahlung trifft auf ein reflektierendes Auflicht-Phasengitter 4, an dem sie reflektiert und gebeugt wird. Die am Auflicht-Phasengitter 4 gebeugte Strahlung wird durch die Abtastplatte 3 und den Kondensor 2 zurückgeworfen und trifft auf eine Platte 5, auf der Photodetektoren 5', -5'; 5'', -5'' angeordnet sind.

10

15 Aus Figur 3 ist ersichtlich, daß das Auflicht-Phasengitter 4 ein Teilungsfeld 4' aufweist, das dem Teilungsfeld 3' der Abtastplatte 3 gleicht. Das Teilungsfeld 4' ist als Phasengitter mit einer Gitterkonstanten von 10 μm ausgeführt. Das Umfeld 4''
20 des Teilungsfeldes 4' ist ebenfalls als Phasengitter ausgeführt, weist aber eine Gitterkonstante von nur 4 μm auf. Die unterschiedlichen Gitterkonstanten der Phasengitter von Teilungsfeld 4' und Umfeld 4'' führen zu unterschiedlichen Beugungen, was unter-
25 schiedliche Beugungsbilder auf der Platte 5 mit den Photodetektoren 5', -5'; 5'', -5'' zur Folge hat. Die Furchen und Stufen der Phasengitter verlaufen in Meßrichtung X, was auch aus Figur 3 ersichtlich ist.

30

Gemäß der Darstellung in Figur 1 verläuft die Meßrichtung X demnach senkrecht zur Zeichnungsebene.

Die Strahlung wird nun entsprechend dem Überdeckungs-

grad der Teilungsfelder 3' und 4' der Abtastplatte 3 und des Phasengitters 4 in Richtung der positiven und negativen Beugungsordnungen - von denen hier nur die erste betrachtet werden soll - reflektiert und vom Kondensor 2 fokussiert. In der Brennebene des Kondensors 2 entstehen symmetrisch zur Lichtquelle L Beugungsbilder erster Ordnung. In der Brennebene des Kondensors 2 ist die Platte 5 angeordnet, deren Photodetektoren 5', -5'; 5'', -5'' so plaziert sind, daß die Beugungsbilder erster Ordnung des jeweiligen Phasengitters 4', 4'' genau darauf treffen.

Abgesehen von der Wellenlänge λ des verwendeten Lichtes kann die Lage der Beugungsbilder gezielt verändert werden, indem man die Phasengitter entsprechend ausgestaltet, was später anhand weiterer Ausführungsbeispiele noch näher erläutert werden wird.

In Figur 5 ist schematisch gezeigt, daß die Erfindung bei entsprechender Ausgestaltung auch für Meßeinrichtungen 15 geeignet ist, die im Durchlichtverfahren arbeiten.

Die Strahlung einer Lichtquelle L5 wird durch einen Kondensor 25 auf eine Abtastplatte 35 gerichtet, die ein Teilungsfeld 35' aufweist. Einem weiteren Teilungsfeld 45' ist ein Phasengitter 45 überlagert. Durch eine Abbildungsoptik 25' werden die Beugungsbilder der Lichtquelle L5 in einer Ebene fokussiert, in der lagerichtig Photodetektoren 55', - 55'; 55'', -55'' auf einer Platte 55 angeordnet sind.

Wenn abweichend von der Darstellung gemäß Figur 1 nur dem Teilungsfeld 45' und nicht dem Umfeld 45'' -

oder umgekehrt - ein Phasengitter 45 zugeordnet wird, können Photodetektoren entfallen, da weniger Beugungsbilder entstehen. Diese Maßnahmen sind ins Belieben des Fachmannes gestellt und verlassen nicht
5 den durch die Erfindung gesteckten Rahmen.

Die Photodetektoren 5', -5' und 5'', -5'' sind paarweise und zueinander antiparallel zusammengesaltet, so daß sich das Schaltbild gemäß Figur 6
10 ergibt. Die Auswertung der durch die Photodetektoren erzeugten elektrischen Signale erfolgt durch Abgriff an Punkten R1 und R2, wie in Figur 6 dargestellt ist.

15 Ein typischer Signalverlauf eines Referenzmarken-Gegentaktsignales nach der Erfindung wird in Figur 7 dargestellt. Dieses an den Punkten R1 und R2 der Schaltung gemäß Figur 6 anstehende Signal läßt sich sicher auswerten, da ein ausreichendes Nutz-Stör-
20 signalverhältnis besteht, denn bei Änderung des Abstandes und Verschmutzung verändert sich das Signal im wesentlichen symmetrisch zur Nulllinie (Amplitude).

Die bereits erwähnten Möglichkeiten der Codierung
25 der Referenzmarken bestehen darin, die Phasengitter unterschiedlich auszubilden.

Bereits aus der Ausbildung der Phasengitter 4' und 4'' gemäß Figur 3 ist ersichtlich, daß die zugehörigen Beugungsbilder an verschiedenen Orten auf ihre zugehörigen Photodetektoren $\pm 5'$ und $\pm 5''$ treffen.
30 Bei der gezeigten parallelen Ausrichtung der Phasengitter 4' und 4'' kann also durch den jeweiligen, ein Signal liefernden Photodetektor $\pm 5'$ oder $\pm 5''$
35 eindeutig bestimmt werden, zu welchem Phasengitter 4' oder 4'' das den jeweiligen Photodetektor ± 5

oder $\pm 5''$ beaufschlagende Beugungsbild gehört.

Die Variante des in Figur 3 gezeigten Phasengitters ist die der Rechteckprofil-Phasengitter mit unterschiedlicher Gitterkonstante für das Teilungsfeld 4' und das Umfeld 4'', jedoch mit gleicher (paralleler) Ausrichtung.

In Figur 8 wird im Querschnitt eine Variante mit Echelette-Phasengitter gezeigt, bei der das Teilungsfeld 48' und das Umfeld 48'' unterschiedliche Gitterkonstanten und/oder Ausrichtung aufweisen. Die Beugungsbilder der Beleuchtung werden der Variation entsprechend abgelenkt, und die den einzelnen Beugungsbildern zugeordneten Photodetektoren entsprechend platziert. Dadurch können die einzelnen Referenzmarken codiert und durch Abgriff der entsprechenden Photodetektoren unterschieden werden.

Ferner sind gemäß Figur 9 Kombinationen von Rechteck-Phasengittern mit Echelette-Phasengittern gleicher oder unterschiedlicher Gitterkonstanten für Teilungsfeld und Umfeld möglich, wobei auch hier noch die Ausrichtung der Phasengitter unterschiedlich gemacht werden kann.

Die Ausgestaltung der Phasengitter wird der Fachmann den Einsatzbedingungen entsprechend auswählen und kombinieren. Besondere Bedeutung kommt dabei der gegenseitigen Ausrichtung der Phasengitter zu, da durch unterschiedliche Ausrichtung der Phasengitter und entsprechende Platzierung der zugehörigen Photodetektoren die Codierung der einzelnen Referenzmarken besonders einfach ist.

Die Platzierung der zu den jeweiligen Beugungsbil-
dern gehörigen Photodetektoren ergibt sich aus
den Zusammenhängen der Gittertheorie, die ausführ-
lich in der 1978 veröffentlichten Dissertation
5 von J. Wilhelm "Dreigitterschrittgeber - photo-
elektrische Aufnehmer zur Messung von Lageänderungen"
(TU Hannover) abgehandelt wird. Nach Seite 12 dieser
Druckschrift lautet die Beugungsformel

10
$$\sin \alpha = \frac{k \cdot \lambda}{d}$$

wobei k die Ordnungszahl, λ die Wellenlänge und d
die Gitterkonstante ist.

Nummer:
 Int. Cl.4:
 Anmeldetag:
 Offenlegungstag:

34 16 864
 G 01 B 11/02
 8. Mai 1984
 21. November 1985

FIG. 3

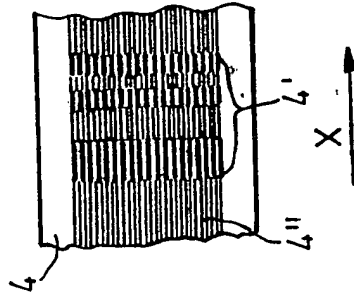


FIG. 2

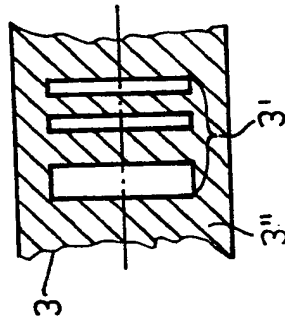


FIG. 1

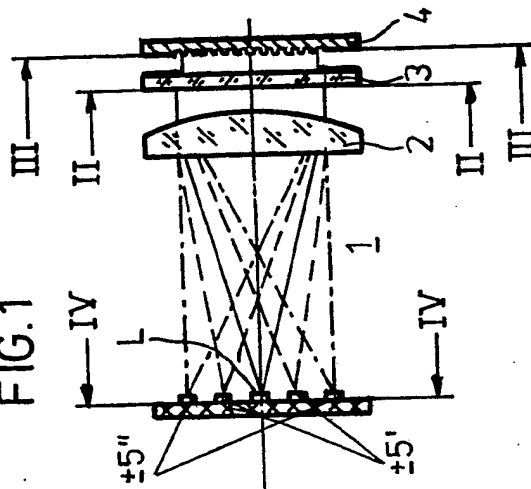


FIG. 4

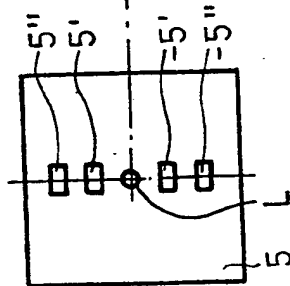
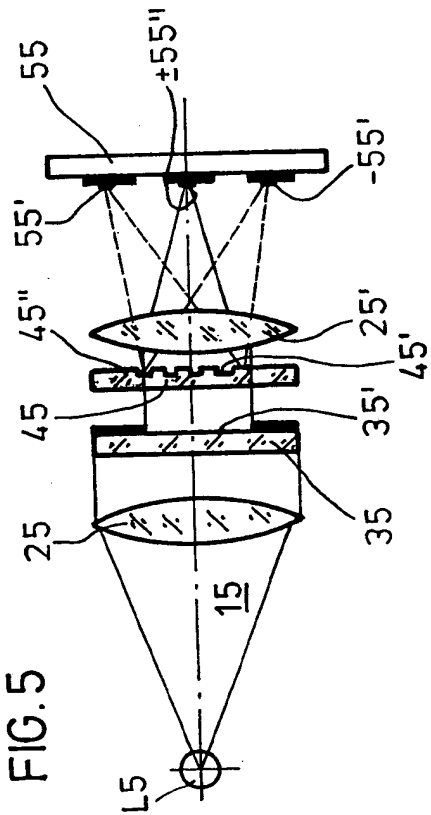


FIG. 5



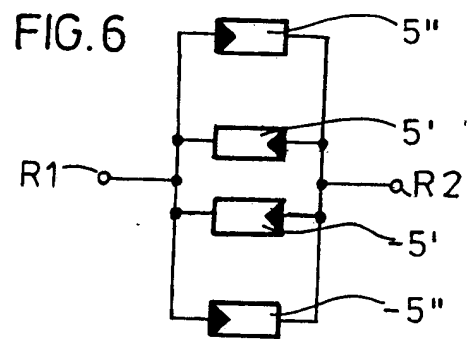


FIG. 7

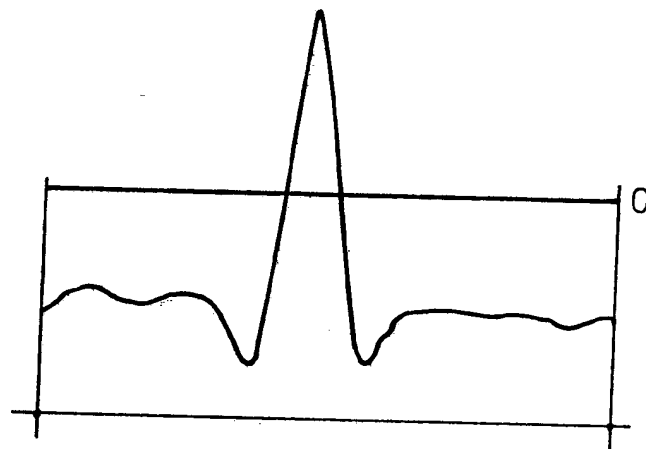


FIG. 8

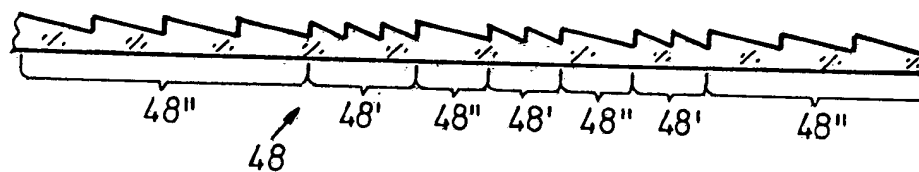


FIG. 9

